

基発0217第2号
令和2年2月17日

一般社団法人日本半導体製造装置協会会長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公 印 省 略)

個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関する
ガイドラインの策定について

標記については、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令（令和2年厚生労働省令第8号）及び作業環境測定基準等の一部を改正する告示（令和2年厚生労働省告示第18号）が、令和2年1月27日に公布及び告示され、令和3年4月1日から個人サンプリング法による作業環境測定が選択的に実施できることとなります。

個人サンプリング法による作業環境測定には、従来の作業環境測定と異なる部分もあることから、個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価の適切な実施を図るため、今般、別添1のとおり「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定したところです。

各団体におかれては、会員事業者に対し、本ガイドラインを周知いただきますようお願い申し上げます。